Also published as:

US7075726 (B2)

US2002024741 (A1)

PROJECTION OPTICAL SYSTEM, PROJECTION ALIGNER BY THIS PROJECTION OPTICAL SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING DEVICE

Publication number: JP2001228401 (A)

Publication date: 2001-08-24

Inventor(s): TERASAWA CHIAKI; ISHII HIROYUKI; KATO TAKASHI

Applicant(s): CANON KK

Classification:

- International: G02B13/18; G02B17/08; G03F7/20; H01L21/027;

G02B13/18; G02B17/08; G03F7/20; H01L21/02; (IPC1-

7): G02B17/08; G02B13/18; H01L21/027

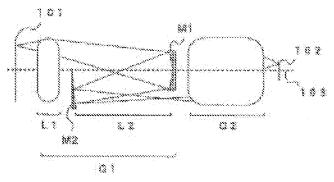
- European: G02817/08U; G02817/08A2; G02B17/08C2; G02B17/08M;

G03F7/20T16

Application number: JP20000037981 20000216 Priority number(s): JP20000037981 20000216

Abstract of JP 2001228401 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projection optical system which does not give rise to the light shielding (drop-out) of the pupil, is capable of assuring high resolving power and a wide exposure region and facilitates assembly and regulation, a projection aligner by this projection optical system and a method for manufacturing the device. SOLUTION: The projection optical system for projecting the image of an object to an image plane has a first image optical system for forming at least an intermediate image of the object described above and a second image optical system for projecting this intermediate image to the image plane in order of the optical paths from the object side. The first image optical system and the second image optical system are arranged along the optical axis of one common straight line. The first image optical system has a mirror and the image of the object is projected to the image plane by abaxial light past the outside of the effective diameter of this mirror.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特i期2001 - 228401 (P2001 - 228401A)

(43)公開日 平成13年8月24日(2001.8.24)

(51) Int.CL7	識別部号	FI	ァーマコート*(参考)
G 0 2 B	17/08	C 0 2 B 17/0	8 A 2H087
	13/18	13/1	8 5F046
HOIL	21/027	HO1L 21/3	9 515D

審査請求 有 請求項の数37 OL (全 71 頁)

(21)出顯番号	特爾2000-37981(122000-37981)	(71)出額人	900001007
			キヤノン株式会社
(22) 出版日	平成12年2月16日(2000.7.16)		東京都大田区下丸子3 厂目30番2号
		(72)発明者	寺沢 千明
			東京都大田区下丸子3 『目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72)発明者	石井 弘之
			東京都大田区下丸子3 [目30番 2 号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	100105289
		() () () () ()	介理士 長尾 達也
			District story and the

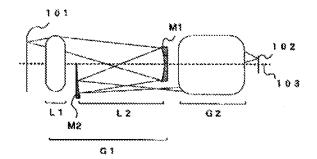
最終質に続く

(54)【発明の名称】 投影光学系、および該投影光学系による投影應光装置、デバイス製造方法

(57)【要約】

【課題】瞳の遮光(中抜け)が起こらず、レンズの構成 枚数が少なく、かつ高解像力と広い義光領域が確保で き、組立調整が容易な投影光学系、および該投影光学系 による投影霧光装置。デバイス製造方法を提供する。

【解決手段】物体の像を像面へ投影する投影光学系において、前記物体側からの光路順に、少なくとも前記物体の中間像を形成するための第1結像光学系と、該中間像を像面へ投影するための第2結像光学系とを有し、前記第1結像光学系と第2結像光学系とは共通の一直線の光軸に沿って配置してあり、前記第1結像光学系がミラーを備え、該ミラーを介し該ミラーの有効経外を通過させた軸外光によって、物体の像を像面へ投影するように構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】物体の像を像面へ投影する投影光学系において、前記物体側から順に、前記物体の中間像を形成するための第1結像光学系と、該中間像を像面へ投影するための第2結像光学系とを有し、前記第1結像光学系と前記第2結像光学系とは共通の一直線の光軸に沿って配置してあり、前記第1結像光学系が前記物体からの軸外光を反射し且つ集光する第1のミラーを有し、前記第1結像光学系が前記第1のミラーを有するか、或は前記第2結像光学系に入射させる第2のミラーを有するか、或は前記第2結像光学系が前記第1のミラーからの光を前記像面側へ反射する第2のミラーを有し、該第2のミラーにより前記軸外光を前記第1のミラーの有効径外を通過させることを特徴とする投影光学系。

【請求項2】前記第1結像光学系の倍率βは、「β」と 1であることを特徴とする請求項1に記載の投影光学 系。

【請求項3】前記第1結像光学系が、少なくとも1枚の レンズを有することを特徴とする請求項1または請求項 2に記載の投影光学系。

【請求項4】前記レンズが、正の屈折力を有することを 特徴とする請求項3に記載の投影光学系。

【請求項5】前記第2結像光学系が、少なくとも1枚の レンズを有することを特徴とする請求項1~4のいずれ か1項に記載の投影光学系。

【請求項6】前記レンズが、正の屈折力を有することを 特徴とする請求項5に記載の投影光学系。

【請求項7】前記第1のミラーと第2のミラーの間に、 レンズ群を有することを特徴とする請求項1~6のいず れか1項に記載の投影光学系。

【請求項8】前記レンズ群が、負の屈折力を有し、前記 第1結像光学系における正の屈折力を有する屈折レンズ と、凹面鏡からなる第1のミラーとの間に配置されてい ることを特徴とする請求項7に記載の投影光学系。

【請求項9】前記第1結像光学系と前記第2結像光学系との間に、前記第1結像光学系の職を前記第2結像光学系の職上へ投影するフィールド光学系を有し、前記第1結像光学系が少なくとも前記第1のミラーを含む正屈折力の第1ミラー群と前記第2のミラーを含む第2ミラー群の2つのミラー群を備え、前記第2ミラー群により反射された前記第1ミラー群からの光束を、前記第1ミラー群の有効径外を通過させるように構成したことを特徴とする請求項1に記載の投影光学系。

【請求項10】前記第2結像光学系は、レンズのみで構成され、正の屈折力を有することを特徴とする請求項9 に記載の投影光学系。

【請求項11】前記第2結像光学系は、その倍率をBG 2としたとき、

-0.5<8G2<-0.05

を満足することを特徴とする請求項9または請求項10

に記載の投影光学系。

【請求項12】前記第1結像光学系は、その倍率をBG 1としたとき、

-40.0 < BG1 < -0.5

を満足することを特徴とする請求項9~11のいずれか 1項に記載の投影光学系。

【請求項13】前記フィールド光学系は、全てレンズで 構成したことを特徴とする請求項9~12のいずれか1 項に記載の投影光学系。

【請求項14】前記フィールド光学系は、第1フィールドミラーと、第2フィールドミラーを含む第2フィールドミラーを含む第2フィールドミラー群を有し、前記第1ミラー群の有効径外を通過した軽外光を前記第1フィールドミラーの順に反射させた後に、前記第1フィールドミラーの光軸中心近傍を通って前記第2結像光学系に入射するように構成されていることを特徴とする請求項9~12のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項15】前記第1フィールドミラーを凹面鏡、前 記第2フィールドミラーを凸面鏡としたことを特徴とす る請求項14に記載の投影光学系。

【請求項16】前記第1フィールドミラーを凹面鏡。前 記第2フィールドミラーを凹面鏡としたことを特徴とす る請求項14に記載の投影光学系。

【請求項17】前記第1結像光学系のペッツバール和を P1、前記フィールド光学系のペッツバール和をPf、 前記第2結像光学系のペッツバール和をP2としたと き、

PI < 0

Pf+P2>0

を満足することを特徴とする請求項9~16のいずれか 1項に記載の投影光学系。

【請求項18】前記物体と前記第1ミラーの近軸距離を LM1、前記物体から前記第1ミラーより前記物体側に ある光学業子により形成する臓共役点までの距離を e と したとき、これらの関係が。

0.6 < e/LM1 < 2.5

を満足することを特徴とする請求項9~17のいずれか 1項に記載の投影光学系。

【請求項19】前記第1ミラーと前記第2ミラーの近軸 距離をしM2、物体摘から第1結像系による中間像まで の光路に沿った近軸距離をOILとしたとき、前記距離 LM1との関係が、

0.5<01L $/(LM1+2\times LM2)<20$

を満足することを特徴とする諸求項9~18のいずれか 1項に記載の投影光学系。

【請求項20】前記距離LM1と前記距離LM2との関係が

0.2<LM2/LM1<0.95

を満足することを特徴とする請求項9~19のいずれか 1項に記載の投影光学系。 【請求項21】前記投影光学系に関する物体面から像面までの距離をしとしたとき、前記距離しM1との関係が、

0.15<LM1/L<0.55

を満足することを特徴とする請求項9~20のいずれか 1項に記載の投影者学系。

【請求項22】前記第1ミラー群の倍率をBGM1としたとき。

-2.0 < 1/BGM1 < 0.4

を満足することを特徴とする請求項9〜21のいずれか 1項に記載の投影光学系。

【請求項23】前記第1結像光学系は最も前記物体側に 正屈折力のレンズ群を配置したことを特徴とする請求項 9~22のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項24】前記第1ミラー群は、前記物体側から順に負屈折力のレンズ。前記第1ミラー、前記負屈折力のレンズを有することを特徴とする請求項9~23のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項25】第2ミラー群は、前記物体側からの順に 光レンズ、前記第2ミラー、前記レンズを有することを 特徴とする請求項9~24のいずれか1項に記載の投影 光学系。

【請求項26】前記物体からの軸外光束が、前記第1ミラー群に入射する前に前記第2ミラー群のレンズを通過することを特徴とする請求項9~25のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項27】前記第1結像光学系の前記第1ミラー群の像面側直後に、前記フィールド光学系に属する正レンズを配置したことを特徴とする請求項9~26のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項28】前記第2フィールドミラーと前記第1フィールドミラーの距離をLFM1、第2フィールドミラーと像面の距離をLFM2としたとき、0.45ベレドM1/LFM2<0.8を満足することを特徴とする請求項14~16のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項29】前記第2フィールドミラー群は、前記物体側から順にレンズ。前記第2フィールドミラー、前記レンズを有することを特徴とする請求項14~16、請求項28のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項30】前記第1結像系の第1ミラーと前記フィールド光学系の第2フィールドミラーの間にフィールド 光学系に属する正レンズを配置し、第1結像系の第2ミラーで反射した光東が前記正レンズを通り第1フィール ドミラーで反射するように構成されていることを特徴とする請求項14~16、請求項28、請求項29のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項31】前記物体側と前記像面側の双方がテレセントリックであることを特徴とする請求項1~30のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項32】前記投影光学系の倍率は、縮小倍率であ

ることを特徴とする請求項1~31のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項33】前記第1結像光学系による中間像の位置に、前記像面での結像領域の大きさ及び/又は形状を可変とする可変視野殺りを配置したことを特徴とする請求項1~32のいずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項34】前記第2結像光学系中に絞りを有することを特徴とする請求項1~330以ずれか1項に記載の投影光学系。

【請求項35】請求項1~34のいずれか1項に記載の 投影光学系によってマスクのバターンを基板上に投影す る投影露光装置。

【請求項36】請求項35に記載の投影露光装置を用いて前記マスクとしてのレチクルのデバイスパターンを前記基板としてのウェハに露光する段階と、該露光したウェハを環像する段階とを含むことを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項37】前記鑑光にArFエキシマレーザ又はF 2レーザからのレーザ光を用いることを特徴とする請求 項36に記載のデバイス製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は投影光学系、および 該投影光学系による投影総光装置、デバイス製造方法に 関し、特にレチクルバターンを半導体ウェハに投影器光 する投影光学系に、反射ミラーを用いた反射屈折投影光 学系に関するものである。

100021

【従来の技術】近年、集積回路の高集積化が進むに従 い、投影露光光学系に対する要求仕様、要求性能もます ます厳しいものになってきている。一般に高い解像力を 得るためには露光波長の短波長化、NAの高NA化が行 われている。しかしながら露光波長の短波長化が193 nm (ArFエキシマレーザ光) や157nm (F2エ キシマレーザ光)といった領域に達すると使用可能なレ ンズ材料が石英と蛍石に限られてくる。これは主に透過 率の低下に起因するものである。従来、例えば特開昭1 0-79345号公報等に開示されているような全て厢 折レンズで構成され、レンズ構成枚数が多く全硝材厚が 大きい光学系では、ウェハー上での露光量が低下するた めスループットが低下することとなり、またレンズの熱 吸収による焦点位置の変動、収差変動などの問題(熱収 差)が生じてくる。鑑光波長が193nmでは石英と蛍 石が使用されるが、それらの分散の差が大きくないため 色収差の補正が難しく、完整に補正しようとすると色消 し面の曲率半径が小さい色消しレンズが数個必要になる ため、光学系の全硝材厚の増大を招き、前述の透過率、 熱収差の問題が起こってくる。また現状、蛍石に関して は、投影光学系の設計性能を保証するに耐えうる特性を 有するものを製造するのが難しく、さらに大口径のもの を製造するのが困難な状況である。このことは色補正を さらに難しくし、コストアップの要因となっている。さ らに鑑光波長が157nmとなると使用可能なレンズ材 料は蛍石のみとなり単一材料だけでは色収差を補正する ことはできない。いずれにしても屈折系だけで投影光学 系を構成することが困難になってくる。

【0003】そのため、光学系中にミラーを使用し反射系とすることにより、前述の透過率、色補正といった課題を回避しようとする提案が種々なされている。例えば、反射系だけで構成されている反射投影光学系が特開平9-211332号公報、特開平10-90602号公報等で開示されている。また、反射系と展析系を組み合わせた反射屈折投影光学系が、米国特許第5,650,877号明細書、特開昭62-210415号公報、特開昭62-258414号公報、特開昭63-163319号公報、特開平2-66510号公報、特開平3-282527号公報、特開平4-234722号公報、特開平5-188298号公報、特開平6-230287号公報、特関平8-304705号公報等で開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような露光波長の 短波長化や高NA化に対応し、反射系を含んだ投影光学 系構築するとき、色収差補正が可能なことは当然とし て、理想的には、像面上で十分な大きさの結像領域が得 られ、ミラー、レンズといった光学素子の枚数が少な く」ミラーへの入反射角が大きくなく。十分な像側作動 距離を確保でき、簡素な構成が望ましい。像面上で十分 な大きさの結像領域幅が得られれば、走査型投影露光装 置ではスループット上有利であり、霧光変動を抑えるこ とができる。枚数が少なければ、ミラー、レンズといっ た光学素子を製造する上での工程負荷を軽減でき、全硝 材厚を小さくすることにもなるので光量損失も減少させ ることができ、さらに装置のフットプリントの増大を抑 制することにもなり、また膜による光量損失を減少させ ることにもなる。。特に露光波長が157nm(F2エ キシマレーザ光)になるとミラーの反射膜での光量損失 も無視できなくなるのでなおよい。ミラーへの入反射角 が大きくなければ反射膜の角度特性による光量変化の影 響を抑制できる。十分な像側作動距離を確保できれば、 装置のオートフォーカス系やウェバーステージの搬送系 などを構成する上で好ましい。簡素な構成であれば、メ カ鏡筒等も複雑化させることはなく組立製造上のメリッ 下がある。以上のような視点から従来例について検証す ると、まず、米国特許第5,650,877号明報書で は、光学系中にマンジンミラーと屈折部材を配置して、 レチクルの像をウエハに霧光するものであるが、この光 学系は、使用する全ての画角において腋の中心部分の遮 光(中抜け)が起こるとともに、露光領域が大きくでき ないという欠点を有している。また、露光領域を大きく

しようとすると簸の中心部分の遮光が大きくなり好まし くなく、さらに、マンジンミラーの屈折面がビームスプ リット面を形成しており、その面を通過するごとに光量 は半分になり、傑丽(ウエハ面)では、10%程度に低 下してしまうという点等にも問題を有している。また、 特關平9-211332号公報。特關平10-9060 2号公報では、反射系のみによる構成を基本としている が、収差的(ペッツバール和)にもミラー配覆の上でも 像面上での結像領域幅を十分に確保することが難しく、 また主に像面近傍のパワーが大きい四面鏡が結像作用を 有する構成となっているので高NA化が钢鍵であり、該 四面鏡の直前位置に凸面鏡が配置されるため、十分な像 側作動距離を確保できないという問題がある。また、特 開昭62-210415号公報、特開昭62-2584 1.4号公報は、カセグレン型やシュワルツシルト型のミ ラー系を応用し、ミラー中心部に開口を設けることによ り瞳の中抜けを生じさせ瞳の周辺部分のみを結像に寄与 させる光学系を提案しているが、瞳の中抜けの結集性能 への影響が懸念され、また瞳の中抜けを小さくしようと すると必然的にミラーのパワーが大きくなるのでミラー への入反射角も大きくなり。さらに高NA化を図るとミ ラー径が著しく増大してしまう。また、特開昭63-1 63319号公報、特勝平5-188298号公報、特 開平6-230287号公報では、光路の折れ曲がりに より構成が複雑化しており、中間像を最終像へ結像させ る光学群のパワーの大部分を凹面鏡が担っているため精 成上高NA化が困難であり、凹面鏡と像面の間に配置さ れているレンズ系の倍率が縮小系で正の符号であるた め、像側作動距離が十分に確保できない。また、物像面 を対向させるためには、収差補正には何ら寄与せず光路 を折り曲げるためだけの目的で2枚の平面鏡を必要と し、露光波長が157 nmになると光量損失の上からも 好ましくない。さらに構成上、光路分割の必要から結像 領域福を確保するのも困難であり、光学系が大型化して いるのでフットプリント上も好ましくない。また、特勝 平2-66510号公報、特開平3-282527号公 報では、まず光路がピームスプリッターにより分割され るので、鏡筒構造が複雑化してしまう。そして径が大き いビームスプリッターを必要としこれがプリズム型の場 合はその厚みにより光量損失が大きい。高NAに際して はさらに径が大きくなるので光量損失もますます大きく なってしまう。ビームスプリッターが平板型の場合は軸 上光線においても非点収差、コマ収差が発生してしまい 問題がある。また熱吸収による非対称収差の発生や光束 分割而での特性変化による収差の発生を招き、製造面で 精度良くビームスプリッターを作成することも難しい。 【0005】さて、特開平4-234722号公報、特 開平8-304705号公報は、以上説明した従来例の 問題点をかなり解決できているが、光路を折り曲げるこ

とにより凹面鏡からの光路を分割していて、腐芯光学的

な取扱いが必要となるため、構造が複雑で組み立て調整 等も難しい。

【0006】そこで、本発明は、上記特開平4-234 722号公報、特開平8-304705号公報における 光学系を改善し、メカ構造が簡単で組み立て調整が容易 な投影光学系、および該投影光学系による投影露光装 置、デバイス製造方法を提供することを目的とするもの である。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を達成するため、つぎの(1)~(37)のように構成した投影光学系、および該投影光学系による投影露光装置。 デバイス製造方法を提供する。

- (1)物体の像を像面へ投影する投影光学系において、前記物体側から順に、前記物体の中間像を形成するための第1結像光学系と、該中間像を像面へ投影するための第2結像光学系とを有し、前記第1結像光学系と前記第2結像光学系とは共通の一直線の光軸に沿って配置してあり。前記第1結像光学系が前記物体からの軸外光を反射し且つ集光する第1のミラーを有し、前記第1結像光学系が前記第1のミラーを有し、前記第1結像光学系が前記第1のミラーを有するか、或は前記第2結像光学系が前記第1のミラーを有するか、或は前記第2結像光学系が前記第1のミラーの有効径外を通過させることを特徴とする投影光学系。
- (2)前記第1結像光学系の倍率βは、 | β | ≥ 1であることを特徴とする上記(1)に記載の投影光学系。
- (3)前記第1結像光学系が、少なくとも1枚のレンズを有することを特徴とする上記(1)または上記(2)に記載の投影光学系。
- (4) 前記レンズが、正の屈折力を有することを特徴とする上記(3) に記載の投影光学系。
- (5)前記第2結像光学系が、少なくとも1枚のレンズを有することを特徴とする上記(1)~(4)のいずれかに記載の投影光学系。
- (6)前記レンズが、正の屈折力を有することを特徴と する上記(5)に記載の投影光学系。
- (7)前記第1のミラーと第2のミラーの間に、レンズ 群を有することを特徴とする上記(1)~(6)のいず れかに記載の投影光学系。
- (8)前記レンズ群が、負の屈折力を有し、前記第1結 像光学系における正の屈折力を有する屈折レンズと、凹 面縁からなる第1のミラーとの間に配置されていること を特徴とする上記(7)に記載の投影光学系。
- (9) 前記第1結像光学系と前記第2結像光学系との間に、前記第1結像光学系の瞳を前記第2結像光学系の瞳 上へ投影するフィールド光学系を有し、前記第1結像光 学系が少なくとも前記第1のミラーを含む正屈折力の第 1ミラー群と前記第2のミラーを含む第2ミラー群の2

つのミラー群を備え、前記第2ミラー群により反射された前記第1ミラー群からの光束を、前記第1ミラー群の 有効径外を通過させるように構成したことを特徴とする 上記(1)に記載の投影光学系。

- (10)前記第2結像光学系は、レンズのみで構成され、正の履折力を有することを特徴とする上記(9)に 記載の投影光学系。
- (11)前記第2結像光学系は、その倍率をBG2としたとき、
- -0.5<BG2<-0.05

を満足することを特徴とする上記(9)または上記(1 0)に記載の投影光学系。

(12)前記第1結像光学系は、その倍率をBG1としたとき、

-40.0<BG1<-0.5

を満足することを特徴とする上記(9)~(11)のいずれかに記載の投影光学系。

- (13)前記フィールド光学系は、全てレンズで構成したことを特徴とする上記(9)~(12)のいずれかに記載の投影光学系。
- (14)前記フィールド光学系は、第1フィールドミラーと、第2フィールドミラーを含む第2フィールドミラー群の有効径外を通過した軸外光を前記第1フィールドミラー、前記第2フィールドミラーの順に反射させた後に、前記第1フィールドミラーの光軸中心近傍を通って前記第2結像光学系に入射するように構成されていることを特徴とする上記(9)~(12)のいずれかに記載の投影光学系。
- (15)前記第1フィールドミラーを四面鏡、前記第2 フィールドミラーを凸面鏡としたことを特徴とする上記 (14)に記載の投影光学系。
- (16)前記第1フィールドミラーを凹面鏡、前記第2 フィールドミラーを凹面鏡としたことを特徴とする上記 (14)に記載の投影光学系。
- (17)前記第1結像光学系のペッツバール和をP1、 前記フィールド光学系のペッツバール和をPf、前記第 2結像光学系のペッツバール和をP2としたとき、

 $P1 \le 0$

Pf+P2>0

を満足することを特徴とする上記(9)~(16)のいずれかに記載の投影光学系。

- (18)前記物体と前記第1ミラーの近軸距離をLM 1、前記物体から前記第1ミラーより前記物体側にある 光学素子により形成する極共役点までの距離をeとした とき、これらの関係が、
- 0.6 < e/LM1 < 2.5

を満足することを特徴とする上記(9)~(17)のいずれかに記載の投影光学系。

(19)前記第1ミラーと前記第2ミラーの近軸距離を LM2、物体面から第1結像系による中間像までの光路 に沿った近難距離をOILとしたとき、前記距離LM1 との関係が、

0.5<01七/(LM1+2×LM2)<20を満足することを特徴とする上記(9)~(18)のいずれかに記載の投影光学系。

(20)前記距離しM1と前記距離しM2との関係が、0,2<しM2/しM1<0、95

を満足することを特徴とする上記(9)~(19)のいずれかに記載の投影光学系。

(21)前記投影光学系に関する物体面から像面までの 距離をしとしたとき、前記距離しM1との関係が、

0.15<LM1/L<0.55

を満足することを特徴とする上記(9)~(20)のいずれかに記載の投影光学系。

(22)前記第1ミラー群の倍率をBGM1としたと き、

-2.0<1/8GM1<0.4

を満足することを特徴とする上記(9)~(21)のいずれかに記載の投影光学系。

(23)前記第1結像光学系は最も前記物体側に正屈折 力のレンズ群を配置したことを特徴とする上記(9)~ (22)のいずれかに記載の投影光学系。

(24)前記第1ミラー群は、前記物体側から堰に負屈 折力のレンズ。前記第1ミラー、前記負屈折力のレンズ を有することを特徴とする上記(9)~(23)のいず れかに記載の投影光学系。

(25)第2ミラー群は、前記物体側からの単に光レンズ、前記第2ミラー、前記レンズを有することを特徴とする上記(9)~(24)のいずれかに記載の投影光学系。

(26) 前記物体からの軸外光束が、前記第1ミラ一群 に入射する前に前記第2ミラー群のレンズを通過するこ とを特徴とする上記(9)~(25)のいずれかに記載 の投影光学系。

(27)前記第1結像光学系の前記第1ミラー群の像面 側面後に、前記フィールド光学系に属する正レンズを配 置したことを特徴とする上記(9)~(26)のいずれ かに記載の投影光学系。

(28)前記第2フィールドミラーと前記第1フィールドミラーの距離をLFM1、第2フィールドミラーと像 前の距離をLFM2としたとき、

0.45<LFM1/LFM2<0.8

を満足することを特徴とする上記(14)~(16)の いずれかに記載の投影光学系。

(29) 前記第2フィールドミラー群は、前記物体側から順にレンズ、前記第2フィールドミラー。前記レンズを有することを特徴とする上記(14)~(16)、上記(28)のいずれかに記載の投影光学系。

(30)前記第1結像系の第1ミラーと前記フィールド 光学系の第2フィールドミラーの間にフィールド光学系 に属する正レンズを配置し、第1結像系の第2ミラーで 反射した光束が前記正レンズを通り第1フィールドミラーで反射するように構成されていることを特徴とする上 記(14)~(16)、上記(28)、上記(29)の いずれかに記載の投影光学系。

(31)前記物体側と前記像頂側の双方がテレセントリックであることを特徴とする上記(1)~(30)のいずれかに記載の投影光学系。

(32) 前記投影光学系の倍率は、縮小倍率であること を特徴とする上記(1)~(31)のいずれかに記載の 投影光学系。

(33)前記第1結像光学系による中間像の位置に、前記像面での結像領域の大きさ及び/又は形状を可変とする可変視野絞りを配置したことを特徴とする上記(1)~(32)のいずれかに記載の投影光学系。

(34)前記第2結像光学系中に絞りを有することを特徴とする上記(1)~(33)のいずれかに記載の投影 光学系。

(35)上記(1)~(34)のいずれかに記載の投影 光学系によってマスクのパターンを基板上に投影する投 影器光装置。

(36)上記(35)に記載の投影露光装置を開いて前 記マスクとしてのレチクルのデバイスバターンを前記基 板としてのウェハに鑑光する段階と、該鑑光したウェハ を現像する段階とを含むことを特徴とするデバイス製造 方法。

(37)前記露光にArFエキシマレーザ又はF2レーザからのレーザ光を用いることを特徴とする上記(36)に記載のデバイス製造方法。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の一つの実施の形態として は、上記構成を用いて、例えば図1に示す反射屈折投影 光学系を構成することができる(実施の形態1)。10 1は第1の物体(レチクル)、102は第2の物体(ウ エハ)、103は本実施の形態1の光学系の光軸であ る。ここでの光学系は、物体側から順に、少なくとも第 1結像光学系G1と第2結像光学系G2よりなる。第1 結像光学系G1は、少なくとも物体側より順に屈折部材 を有するL1、第1のミラーM1、第2のミラーM2に より構成されており、第1の物体101からの光束を第 1結像光学系G1にて結像し、中間像を形成する。その 際、第1のミラーM1の有効後外を、第1の物体101 からの軸外光束が通過する構成をとっている。そして第 1結像光学系G1により結像した中間像を、隠析部材に より構成されている第2結像光学系G2により、第2の 物体102上に所定の倍率にて結像する。以上のような 構成とすることで、本実施の形態1における光学系は一 つの光軸103を有し、膝の遮光のない軸外光束を結像 する多数囲結像光学系を達成している。

【0009】第1結像光学系G1は、少なくとも1枚以

上の屈折レンズと2枚のミラーにより構成されている。 屈折レンズ料し1は、主に物体側のテレセン度を確保し かつ歪曲収差の補正に質離するとともに、第1のミラー M1に光束が過度に広がらないように入射させている。 第2のミラーM2は、第1のミラーM1と光軸103に 対して対向して配置され、第1のミラーM1からの光束 を光軸103の正方向に折り返し、第1のミラーM1の 有効径外へと光束を導いている。尚、第1の物体101 から第2の物体102の方向を正方向としている。この ような構成を取ることにより、瞳の中抜けを起こすこと なく、また光軸を曲げることなく第2結像光学系に光束 を選ぶことが可能となる。

【0010】屈折レンズ群し1は、正の屈折力を有する のが望ましい。正の屈折力を有することで、第1のミラ 一組1への入射高さを過度に大きくしないとともに、第 1のミラーM1への光軸に対する入射角を大きくするこ とができ、第2のミラーM2での光束の分離を容易にで きる。また、第1のミラーM1は凹面鏡にて構成するの が好ましい。本実施の形態1の光学系において、第1結 像光学系G1における瞳は第1のミラーM1の前後に存 在し、その近辺では第1結像光学系G1において各画角 の光束の幅が大きくなるとともに、画角の違いによる光 **東のぼらつきが少なくなる。従って、第1のミラーM1** は、正のパワーを有することで、即ち四面鏡にて構成す ることで、屈折レンズ群し1からの各画角の光東を収束 させ、第2のミラーM2以後の光束の分離をより容易に できるとともに像面湾曲をオーバー方向に発生させて、 第2結像光学系G2におけるアンダーの像面湾曲を打ち 消す効果を有することができる。

【0011】また、第2のミラーM2は、第1のミラーM1からの光束を光軸103の正方向に折り返す役割を有している。尚、第2のミラーは凹面鏡でも、平面ミラーでも、或いは凸面ミラーでも構わない。パワー配置の違いによって必要な形状を有すればよい。但し、第1結像光学系G1において、第2結像光学系G2の像面湾曲及び諸収差を打ち消すためには、第2のミラーM2も凹面鏡にて構成すれば第1のミラーM1の屈折力を分担できるため、より望ましい。

【0012】第2結像光学系G2は、第1結像光学系G1により結像した中間像を第2の物体上に結像する機能を有する。第2結像光学系G2は、第1結像光学系G1により発生したオーバー方向の像面湾曲等の諸収差をキャンセルする関係にある。この第2結像光学系G2は、履折レンズ系にて構成している。最終結像光学系を配析レンズ系にて構成することにより、高い開口数を有する光学系を容易に構成することにより、高い開口数を有する光学系を容易に構成することが可能となる。また、この第2結像光学系G1における光束の辐が過度に増すことを防ぐとともに、第1のミラーM1と第2のミラーM2による光束の分離をより容易にしている。また、この第2結

像光学系G2中に開口絞りを有している。

【0013】尚、屈折レンズ群Rを、第1のミラーM1 及び第2のミラーM2の2枚のミラーを含む群し2中に 配置してもよい。図2は、図1中に屈折レンズ群音が配 置されたときの概略図を示す。ここで、図1と同じ番号 のものは同一の機能を有するものとする。屈折レンズ群 Rが屈折レンズ群し1と第1のミラーM1の間に配置き れるといわゆる往復光学系となる。即ち、屈折レンズ群 Rには、屈折レンズ群L1により屈折された光東が入射 するとともに、第2のミラーM1にて反射された光東も 通過することになる。また、この屈折レンズ群Rを有す る場合には、その屈折力が負であることがより望まし い。この屈折レンズ群Rの屈折力を負とすることで、第 1のミラーM1にて負担しているペッツバール和を分担 するとともに、金系の色収差の補正に寄与することが可 能である。従って、屈折レンズ群Rを構成する場合に は、負の屈折力を有することが望ましい。また同時に、 主に全系の球面収差やコマ収差の補正にも寄与すること ができる。上述の通り、主に軸上色収差の補正等のため には、第1のミラーM1付近に屈折レンズ群Rを配置す るのが好ましいが、第2のミラーR付近に配置しても精 わない。即ち、第1のミラーM1からの反射光束と第2 のミラーの反射光束とを透過する位置に配置しても構わ ない。また、屈折レンズ群阜は、2枚のミラーを含む群 1.2の範囲において、どこに配置しても、又何枚配置し ても構わない。本実施の形態における役影光学系は、特 に2回結像光学系にて達成した場合、正の倍率を有して いる。実施の形態上においては、以上の様な構成をとる ことにより、瞳の中心部の遮光を有することなく。構成 枚数が少なくかつ高解像力と広い露光領域を確保して組 立調整も容易な反射屈折光学系を達成することができ

【0014】また、本発明の別の実施の形態としては、 例えば図3に示す反射屈折投影光学系を構成することが できる(実施の形態2)。これは、物体面のうち像面ま で至り結像に寄与する領域は光軸外の半円弧状(リング フィールド系)で、瞳面上の光束中心部に欠られば皆無 であり、該投影光学系は物体側からの光路順に、物体の 中間像を形成する役割を有する第1結像系Gr1と。該 第1結構系Gr1の瞳を第2結像系Gr2の瞳上へ投影 するフィールド光学系Gritと。像面の直前に位置し最 終像を形成する第2結像系Gr2を有し、第1結像系G r 1は第1ミラーM1を含む正屈折力の第1ミラー群G 311、第2ミラーM2を含む第2ミラー群GM2という。 2つのミラー群を有し、物理的に第2ミラー群GM2は 第1ミラー群GM1よりも物体側に配置され、第1ミラ -M 1 は物体側へ凹面を向けた凹面鏡であり、物体側か らの光束が第1結像系Gr1中で第1ミラーM1。第2 ミラーM2の順に反射された後に、該光東は第1ミラー 群GM1の有効径の外側を通って像面側へ進行し、順に

該フィールド光学系G r f 、該第2結像系G r 2を通過 することにより該投影光学系全系は1直線の光軸上に形 成され、物体面と像面は該光軸の両端に対向して位置 し、投影光学系全系の倍率は縮小倍率であることを特徴 としている。

【0015】図3は本実施の形態2の基本的構成の概略 図、図12~図45は後述するように本実施の形態2を 適用した実施例5~実施例21を示す図である。全ての 実施例において、第1結像系Gr1は2枚のミラーを有 しており、第2結像系Gr2は超折レンズ系のみで構成 されている。図12から図19はフィールド光学系Gr fがすべてレンズ系の場合であり、図20から図28は フィールド光学系Grfが2枚のミラーを有する場合で ある。

【0016】一般に、ミラーを用いると光学系は次のような作用を有することになる。

a、ミラー面では、色収差が発生しない。これにより凹レンズと凹面ミラーを組み合わせることによりいわゆるマンジンミラーとすれば正のパワーとしながら、過剰の色消しを発生させることができる。

b、ミラーが有するパワーとペッツバール和の関係は、 通常の屈折レンズとは逆である。これにより例えば凹面 ミラーは、正のパワーを有しながらもペッツバール和は 負の値を有するので、光学系中のペッツバール和補正の ための負レンズのパワー負担を軽減できる。

c.光線が反射する。これにより物像面を対向させるために、光学系が複雑化する。例えば、瞳の中抜け、リングフィールド。光路折り曲げ等である。

【0017】ここでは、上述した目的を達成するため に、上記ミラーの作用を効果的に利用し光学系に反映さ せており、図3に示すように、第1結像系。フィールド 光学系、第2結像系と、ミラーを用いながらも一本の光 軸上に投影光学系を配置した簡素な構成なっている。こ れによるメリットは大きく、光路を折り曲げる必要がな いので、鏡筒構造を従来の屈折レンズ系と同様な構造と することができ、また光学素子の自重変形についても、 重力方向が光軸方向と一致しているので非対称な変形が 発生せず、非対称収差が発生しにくい。周辺の組立調 整、測定機器関連等の製造上のインフラ設備をそのまま 流用することが可能となり、コスト上のメリットが大き い。さらに、装置のフットプリントも従来の屈折レンズ 系と同程度となるので、占有面積も従来と変わらずユー ザーにとってメリットが大きい。これを可能にしている のは、軸外光のみを結像に寄与させるという光学系コン セプト(リングフィールド系)を設定した上で、第1結 像系G r 1 において上記c. の作用を2回使用し2枚の ミラーで2回の反射を行い、物体からの光束を第1ミラ 一群GM1の有効径外を通って像面側へ進行させている。 という点にある。これにより続く光東はフィールド光学 系Grf、第2結像系Gr2を通り像面上へ到途し、光 軸が1本の光学系を構成できるのである。

【0018】第2結像系Gr2はすべて屈折レンズ系で 構成し正屈折力を有することにより。高NA化に対応可 能とし、さらに像贋作動距離を確保しやすくしている。 仮に第2結像系Gr2が凹面ミラーを有している場合 は、従来例で説明をしたように高NA化、機関作動能能 の確保が困難になってくる。フィールド光学系Grfは 図3のAに示すように全て屈折レンズ系で構成すること も可能であるし、Bに示すように2枚のミラーを有する 構成も可能である。後に実施例で示すように正レンズド 1.1は、パワー配置によっては不要とすることも可能で ある。またBの場合、第1フィールドミラーFM1は囲 面鏡であり、第2フィールドミラーFM2は凸面鏡とい う構成となっているが、第2フィールドミラーFM2は 四面鏡で構成することも可能である。色補正に関しては 第1結像系Gr1の色消し状況を、第1ミラー群GM1 を負屈折力のレンズLN1と凹面の第1ミラーM1で構 成することにより、上記a、の作用を利用して色消し過 刺とすることができるので、レンズ使用硝種が1種類で あっても色収差補正が可能となっている。これは特にA rf、F2光源の場合には、大きなメリットである。

【0019】光学素子の小枚数化や、小型軽量化に関しては、まず本実施形態では戦外光のみを使用したリングフィールド系であるので、籐の中核けを生じるカセグレン型やシュワルツシルト型を応用した光学系よりもミラーの径を小さくすることができ、またミラー枚数も本発明の構成によれば最少2枚と少ない。

【0020】また、第1結像系Gr1の第1ミラー群G M1にて上記り、の作用により、第1結像系Gr1では 大きな負のペッツバール和となるので、従来の屈折レン ズ系のようにペッツバール和補正用の負屈折力レンズを 多用することなしに、フィールド光学系Grf、第2結 像系Gr2を構成することができ、レンズの枚数を少な くすることができる。さらに、第1結集系G r 1の第2 ミラー群GM2をレンズLP1とミラーM2で構成すれ ば、第2ミラー群GM2のトータルのパワーは不変であ りながら、レンズLP1と第2ミラーM2のパワー分担 を変化させることにより、いかようにもペッツバール和 を制御可能となるので、収差補正の自由度が増加し光学 業子枚数の削減に貢献する。これは図3のBに示す第2 フィールドミラードM2においても同様に、第2フィー ルドミラードM2とレンズLFを組み合わせ第2フィー ルドミラ一群とすることによりペッツバール和補正の自 由度が増加し光学素子枚数の削減に貢献する。そして、 第1結像系Grlの大きな負のペッツバール和を打ち消 すべく第2結像系Gr2の正の屈折力も大きくなる必然 性が生じ、かつ、第1結像系のド1から射出する主光線 高が第1ミラー群GM1の外側を通るため高い位置でフ ィールド光学系GFfに入射し、フィールド光学系GF fから第2結像系Gr2に入射する主光線の角度が大き

くなり、これにより像側テレセントリックを保つためには、はやり第2結像系Gr2の正の屈折力が大きくなる必然性が生じ、この2つの必然性から矛盾することなく第2結像系Gr2の正の屈折力を大きくすることができるので第2結像系Gr2の有効径は小きくなり、小型軽量化がなされる。

【0021】ミラーへの入反射角に関して、本実施の形 態ではリングフィールド系であるので、瞳の中抜けを生 じるカセグレン型やシュワルツシルト型を応用した光学 系よりもミラーへの入反射角を小さくすることができ、 また第1結像系Gェーでは第1ミラーMIを籐共役点近 傍に配置し、第2ミラーM2で反射した光束が第1ミラ 一群GM1の有効径外の即近傍を通過するようにしてお り、ミラー上の光軸から離れた高い位置で反射させるこ とがないので、第1ミラーM1,第2ミラーM2とも入 反射角が極端に大きくなることはない。また、フィール ド光学系GrfのBの場合では、第1フィールドミラー FM1と第2フィールドミラーFM2の間隔をできる限 り確保しており光束輻も狭いので、これも入反射角が極 端に大きくなることはない。像面上での結像領域幅に関 しては、有効光束をできるだけ確保するようにミラーを 配置する必要があるが、フィールド光学系Grfが屈折 レンズ系のみのAの場合でもミラーを含むBの場合でも 第1結像系Gr1においては収差補正の許容範囲で物高 を高くすればよいので、障害にはならない。また。フィ ールドミラーを有するBのフィールド光学系Grfで は、光束輻が狭いので有効光束が欠られないようにする ことは容易であり、これも障害にならない。したがって 十分に結像領域幅を確保することは可能である。

【0022】また、第1結像系Gェ1において物体面の 直後に正レンズ群G1を配置することにより、歪曲収差 等の補正に効果を発揮し、かつ物体側テレセントリック 性を良好に保つことが可能となる。したがって物体面 (レチクル)や像面(ウェハー)の反り、デフォーカス による倍率変化を小さくするには正レンズ群G1と第2 結像系Gェ2とによって、物像界で両側テレセントリッ クな光学系とするのが良い。なお、本発明では、図3に 示すように第2ミラーM2は光東分離のためには半円盤 状とする必要があり、正レンズ群G1は半円盤状でも レンズ製造、レンズ保持の容易さから円盤状でも良く。

 $0.5 < OIL/(LM1 + 2 \times LM2) < 20 \cdot \cdot \cdot (5)$

を満足すること、前記距離LM1と前記距離LM2との 関係が、

0.2<LM2/LM1<0、95・・・(6) を満足すること、前記投影光学系に関する物体値から像 値までの距離をしとしたとき、前記距離LM1との関係 が、

0.15ベLM1/L<0.55・・・(7)を満足すること、前記第1ミラー群の倍率をBGM1としたとき、

さらに光軸の下方表面部分に第2ミラーM2を形成する 構成としても良い。同様の理由で、レンズLP1におい ても半円盤状としているが円盤状でも良く、このときは 光東はレンズLP1を3度通過することになる。このと き同様にレンズしP1の下方表面部分に第2ミラーM2 を形成する構成としても良い。 同様に第1ミラーM1も レンズLN1の裏面鏡として構成しても良く。本発明で 使用されるミラーは、どのミラーであっても収差補正の 観点からも、裏面鏡であっても良い。また図3のA、B に示すようにフィールド光学系は、第1結係系Gr1の 第1ミラー群GM1の像面側背後に配置される正レンズ FL1を有することで、径の増大化を抑制することがで き、また正レンズFL1の第1面を2重曲率にする等不 連続な形状にする必要が生じるが、第1ミラーM1を正 レンズF L 1の中心部分に形成しても良い。さらに、第 1結像系の中間像の位置に像面上の結像領域が可変とな る視野絞り配置することもできる。これにより、照明系 (不図示)を簡素化することができる。

【0023】そして、本実施の形態2において、光学系を構成する上では、さらに以下の条件を満足することが好ましい。第2結像系Gr2の倍率をBG2とすると
-0.5<BG2<-0.05・・・(1)

を満足すること、第1結像系G r 1 の倍率を B G 1 とす ると

 $-40.0 < BG1 < -0.5 \cdot \cdot \cdot (2)$

を満足すること、第1結像系Gr1のペッツバール和を P1、フィールド光学系Gr1のペッツバール和をP f、第2結像系Gr2のペッツバール和をP2としたと き。

 $P1 < 0 \cdot \cdot \cdot (3)$

Pf+P2>0

を満足すること、前記物体と前記第1ミラーの近難距離 をLM1、前記物体から前記第1ミラーより前記物体側 にある光学素子により形成する籔共役点までの距離を e としたとき、これらの関係が、

 $0.6 < e/LM1 < 2.5 \cdots (4)$

を満足すること、前記第1ミラーと前記第2ミラーの近 軸距離をLM2、物体面から第1結像系による中間像ま での光路に沿った近軸距離をOILとしたとき、前記距 継LM1との関係が、

-2.0<1/BGM1<0.4・・・(8) を満足することである。

【0024】条件式(1)は、高NA化に対応しながらも、バックフォーカス(像側作動距離)を確保でき良好な結像性能を得ることができるように第2結像系Gr2の倍率を適正な範囲に規定するものである。まず、全範囲において負の値を持つことによりバックフォーカスの確保を容易としている。ここで、下限を越えると、第2結像系Gr2のパワーが小さくなるため第2結像系の径

が増大したり、第2結像系Gr2に対する仮想物体高が低くなってしまうため、フィールド光学系Grfを構成する各群のパワーが大きくなることによって、歪曲収差、像闽湾曲の補正が困難になったり、または第1結像系Gr1の倍率が縮小傾向になりすぎて、第2ミラーM2からの反射光が第1ミラー群GM1と干渉する不具合が生じたりして、パワー配置的に困難になり好ましくない。逆に上限を越えると、第2結像系Gr2のパワーが増大するため収差補正が困難になったり、またフィールド光学系Grfの径が増大したりして好ましくない。

【0025】条件式(2)は、第1結像系Gr1のパワーを適正に保ちながら、第2ミラーM2からの反射光東が第1ミラー群GM1と干渉することなしに効率的に通過するように、第1結像系Gr1の倍率を規定するもので、下限を越えると、第1ミラー群GM1の外側で光東橋が大きくなってフィールド光学系Gr1の増大化を招いたり、第2結像系Gr2のパワーが増大したりして収差補正が困難になってくるので好ましくない。次に上限を越えると、第1結像系Gr1のパワーが増大し、収差補正が困難になったり、第2ミラーM2からの反射光東が第1ミラー群GM1と干渉する不具合が生じ好ましくない、なお条件式(2)の下限は一5.0であればより好ましい。

【0026】条件式(3)は、光学系全体の像面湾曲を規定するペッツバール和に関するもので、全系としてのペッツバール和は略0とすることが望ましいが、本実施の形態においては、第1結像系Grlのペッツバール和は第1ミラー群GM1の存在によって大きな負の値を有し、これを打ち消すようにフィールド光学系Grfのペッツバール和と第2結像系Gr2のペッツバール和の総和は大きな正の値を有する。この条件を満足しない場合は、ペッツバール和を補正するために、レンズ枚数が増大したり、像面湾曲を補正することが困難となり好ましくない。

【0027】条件式(4)は、第1結像系の職共役点と 第1ミラーM1の位置関係に関して規定するもので、高 次の歪曲収差や像面湾曲の低減、前途したミラー入射角 の低減等を考慮するとその位置関係はほぼ一致させるこ とが望ましい。ここで下限を越えると、各物高からの主 光線が第1ミラーM1で反射する高さが異なってしまう ため。高次の歪曲収差、像崩落曲が増大してしまう。ま た、第1ミラー群GM1の径も大きくなってしまうの。 で、第2ミラーM2からの反射光束が第1ミラー群GM 1と干渉してしまう不見合が生じ好ましくない。上限を 越えても、同様に各物高からの主光線が第1ミラーM1 で反射する高さが異なってしまうため。高次の歪曲収 差。像面湾曲が増大してしまう。また。第2ミラーM2 からの反射光楽の角度が光軸に対し大きくなるのでフィ ールド光学系Gェチのパワー負担が大きくなってしまい。 収差補正を困難にさせるので好ましくない。

【0028】条件式(5)は、第1結應系Gr1による 中間像と第1ミラーM1の位置関係に関して規定するも ので、第2ミラーM2からの反射光束が第1ミラー群G 30.1と干渉することなしに効率的に像面側に通過するよ うにしており、図3に示すようにほぼ第1ミラーM1の 外側で中間像を形成するようにするのが好ましい。した がって、この範囲を越えると、第1ミラーM1の外側で 光束穏が大きくなるので、フィールド光学系Gェイにお いて径が増大したり、収差が増加したりして好ましくな い。特に下限を越えると、第1結像系Grlの倍率が縮 小傾向になりすぎるため第2ミラーM2からの反射光束 が第1ミラー群GM1と干渉する不具合が生じたり、第 1ミラーM1、第2ミラーM2のパワーが大きくなりす ぎるため収差発生量が増大して好ましくない。上限を越 えると、逆に第1結像系Gr1の倍率が拡大傾向になり すぎるため、第1ミラーM1の外側に余分なスペースが 生じたり、第2結像系Gr2で倍率をより縮小傾向にし なければならず光学系全系のパワーバランスが崩れるの で好ましくない。なお条件式(5)の上限は3.0であ ればより好ましい。

【0029】条件式(6)は、第1ミラーM1に対し第2ミラーM2の位置を適正に保つように規定しているもので、下限を越えると、物体面から第1ミラーM1に向かう光東が第2ミラーM2によって欠られる不具合が生じ好ましくない。上限を越えると、第2ミラーM2と物体面が接近してしまうので物体面側のスペースが小さくなり装置構成上好ましくない。条件式(7)は、光学系全長に対し、第1ミラーM1の位置を適正に規定しているもので、この範囲を越えると光学系全系のパワーバランスが崩れるため好ましくない。特に、下限を越えると第1結像系Gr1のパワーが増大し、上限を越えると第2結像系Gr2のパワーが増大し、上限を越えると第2結像系Gr2のパワーが増大してペッツバール和や収差の打ち消し関係のバランスが崩れるため好ましくない。

【0030】条件式(8)は、第1結像系Gr1中の第1ミラー群GM1の倍率を規定しているもので、この範囲を越えると、第1ミラー群GM1のパワーが適正な範囲を越えてしまうので第2ミラーM2からの反射光束が第1ミラー群GM1の外側を通過させるための第2ミラー群GM2のパワーが規制されて、高次の歪曲収差や像面湾曲の発生を招いたり、光束が第1ミラー群GM1群と干渉する不具合が生じたり、また第2結像系Gr2とのパワーバランスにも影響し収差補正が困難となるので好ましくない。特に下限を越えると、第1ミラー群GM1のパワーが大きくなるので第1結像系Gr1の倍率が拡大側に増大するので、第2結像系Gr2のパワーが増大し、上限を越えると、第1結像系Gr1の倍率が拡大側に増大するので、第2結像系Gr2のパワーが増大し、いずれも収差補正が困難になってくる。なお条件式(8)の上限は一0、2であればより好ましい。

【0031】また、特に図3のBのような実施の形態で

は、フィールド光学系Grfは物体側へ凹面を向けた凹 面鏡の第1フィールドミラードM1と、第2フィールド ミラーFM2を含む第2フィールドミラー群GFM2を 有し、物理的に第1フィールドミラードM1は第2フィ ールドミラー群GFM2よりも像面側に配置され、第2 結像系G r 2は屋折レンズのみで構成され正屋折力を有 し、物体側からの光束が第1結像系Gr1では第1ミラ ーM1、第2ミラーM2の順に反射された後に、第1ミ ラー群GM1の有効径の外側を通って像面側へ進行し。 次にフィールド光学系Grfでは第1フィールドミラー FM1、第2フィールドミラーFM2の順に反射された 後に、第1フィールドミラードM1の光軸中心近傍を通 って像面側へ進行し、最終的に第2結像系Gr2を通過 することにより該投影光学系全系は1直線の光軸上に形 成され、物体面と像面は該光軸の両端に対向して位置 し、投影光学系全系の倍率は縮小倍率であることを特徴 としている。

【0032】本実施の図3のBのような形態に特徴的な 点は、第1結像系Gr1において上記c.の作用を2回

 $0.6 < OIL/(LM1+2 \times LM2) < 20 \cdot \cdot \cdot (11)$

を満足すること、前記の距離LM1、投影光学系全体の 共役長しに関し、

O. 25 < LM1/L < O. 55・・・(12) を満足すること、第1ミラー群GM1の倍率をBGM1 とすると。

1、2<1/BGM1<0、4・・・(13)を満足すること、第2フィールドミラーFM2と第1フィールドミラーFM1の距離しFM1、第2フィールドミラーFM2と像面の距離しFM2に関し、

0.45<LFM1/LFM2<0.8・・・(14)を満足することである。

【0034】条件式(9)から(13)については、前述した内容と同様である、条件式(14)は、像面、第1フィールドミラーFM1、第2フィールドミラーFM2の位置関係について規定しているもので、下限を越えると、第1フィールドミラーFM1と第2フィールドミラーFM2の間のスペースが狭くなり、それぞれのミラーのパワーが大きくなってくるのでミラー面での収差発生が増大し好ましくない。上限を越えると、第2結像系Gr2を構成するためのレンズスペースが狭くなり、各レンズのパワーが増加することによる収差発生が大きくなり好ましくない。

【0035】以上のように、本実施の形態2においては、光学系を第1結像系、フィールド光学系、第2結像系で構成し、第1結像系の2枚のミラーで2回反射を行い光東を像面側に通過させることによって、光軸が一本の簡素な構成を実現しており、また、各結像系、各ミラー群の倍率分担、各ミラーの位置関係等を所定の条件を満足するように規定することにより、十分な結像領域幅が得られ、小型軽量で光学素子の枚数が少なく。ミラー

利用し第1ミラーM1、第2ミラーM2と2枚のミラーで2回の反射を行い、物体からの光束を第1ミラー群GM1の有効径外を通って像面側へ進行させているという点と、フィールド光学系Grfにおいても上記上記c、の作用を2回利用し、第1フィールドミラーFM1、第2フィールドミラーFM2と2枚のミラーで2回の反射を行い、光束を第1フィールドミラーFM1の光軸中心部分を通って像面側へ進行させていることにある。

【0033】この形態の光学系を構成する上では、さらに以下の条件を満足することが好ましい。第1結像系のr1の倍率をBG1とすると、

 $-40.0 < BG1 < -0.9 \cdot \cdot \cdot (9)$

を満足すること、物体面と第1ミラーM1の距離しM 1、第1ミラーM1より物体側にある光学素子により形成される腋共役点の距離をに関し、

 $0.8 < e / LM1 < 1.5 \cdots (10)$

を満足すること、前記の距離しM1、第1ミラーM1と 第2ミラーM2の距離しM2、物体面から第1結像系G r1による中間像までの近軸距離O1しに関し。

への入反射角が大きくなく、十分な像側作動距離を確保 できる反射屈折投影光学系を達成している。

[0036]

【実施例】以下に、本発明の実施例について説明する。 なお、実施例1~実施例4は上記実施の形態1を適用し た例であり、また、実施例5~実施例21は上記実施の 形態2を適用した例である。

【0037】 [実施例1]実施例1の具体的なレンズ構成を図4に示す。投影倍率は1/4倍であり、基準波長は157nm、硝材としては強石を用いている。物体側から順に、正の屈折力を有する屈折レンズ群し1。後置される第1のミラーM1への入射光と反射光の両方が透過する往復光学系である屈折レンズ群日、第1のミラーである凹面鏡M1、第2のミラーである凹面鏡M2、フィールドレンズ群F、及び第2結像光学系G2より構成されている。本実施例は、像側の開口数はNA=0.

6、縮小倍率1/4、物像問距離(第1の物体而へ第2の物体面)はL=約1170mmである。また、基準被長は157nm。像高がおよそ11,25~19、75mmの範囲にて収差補正されており、少なくとも長さ方向で26mm、揺で8mm程度の円弧状の露光領域を確保できる。また、本実施例の組及び積収差図を図8に、数値実施形態の構成諸元値を表1に示す。尚、収差図は基準波長及び±2pmの波長について表示している。

【〇〇38】 庭折レンズ群し1は、物体側より順に、両 凸形状の非球面正レンズ、物体側に凸面を向けた略平凸 形状の非球面正レンズよりなる。 屈折レンズ群し1によ り、テレセン度と歪曲収差のパランスを良好にするとと もに、第1のミラーM1及び往復光学系Rへ光束を屈折 きせている。往復光学系である屈折レンズ群Rは物体側 に凹面を向けたメニスカス形状の非球面負レンズにより 構成されている。この負レンズにより、主に像面湾曲及 び軸上色収差を補正している。また非球面により、主に 球面収差及びコマ収差等を補正している。

【0039】第1のミラーM1は、物体側に関値を向けた非球画関値鏡にて構成されており、正の屈折力を有するとともに、像値湾曲を正方向に出して、屈折レンズにて構成されている第2結像光学系の負の像面湾曲を打ち消す働きを有する。第2のミラーM2は、像側に凹面を向けた凹面鏡にて構成されており、第1の物体101上の軸外光束を第1のミラーM1の有効径外へと導いている。中間像は、第1のミラーM1の有効径外の近傍に形成されている。本実施例において第1結像光学系は拡大系であり、第1のミラーM1からの反射光束と、第2のミラーM2からの反射光束との分離を容易に達成することができる。本実施例においては、中間像付近に1枚の両凸形状の非球面レンズをフィールドレンズ群Fとして配置している。

【0040】第2結像光学系G2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の非球面正レンズ、開口絞り、像側に凸面を向けた蜂平凸形状の非球面正レンズ、像側に凸面を向けた非球面正レンズ、像側に凹面を向けた非球面レンズ、像側に凸面を向けた非球面レンズ、物体側に凸面を向けた非球面正レンズ、よりなる。この第2結像光学系G2は、フィールドレンズ群下からの光東を第2の物体面上102に結像するために縮小系を構成し、開口絞りに対して光束に角度を持って入射させることにより、開口絞り付近の屈折レンズの有効径を小さく抑えている。このような配置を採ることにより、軸上色収差や球面収差等の諸収差の発生を低減するともに、第1結像光学系にて発生する諸収差と打ち消しあうことで、金系において良好な収差補正を達成している。

【0041】尚、本実施例においては、第2のミラーM 2は球面ミラーにて構成されており、それ以外の素子は 全て非球面にて形成されているが、第1結像光学系G1 及び第2結像光学系G2における屈折レンズ、及び第1 のミラーM1は必ずしも全て非球面である必要はない。 球面レンズ、球面ミラーでも構わない。但し、非球面を 用いることによって諸収差をより良好に補正することが 可能である。

【0042】[実施例2]実施例2の具体的なレンズ構成を図5に示す、投影倍率は1/4倍であり、基準波長は157nm。硝材としては蛍石を用いている。物体側から順に、正の屈折力を有する屈折レンズ群し1.後置される第1のミラーM1への入射光と反射光の両方が透過する往復光学系である屈折レンズ群R、第1のミラーである凹面鏡M1、第2のミラーである平面鏡M2、フィールドレンズ群F、及び第2結像光学系G2より構成されている。本実施例は、像側の開口数はNA=0.6

0、縮小倍率1/4、物像間距離(第1の物体面〜第2の物体面)はL=約1205mmである。また、傷高がおよそ10~16、25mmの範囲にて収差補正されており、少なくとも長き方向で26mm、幅で4mm程度の円無状の露光領域を確保できる。また、本実施例の縦及び横収差図を図9に、数値実施形態の構成諸元値を表2に示す。尚、収差図は基準波長及び±2pmの波長について表示している。

【0043】本実施例の具体的な構成について説明する。屈折レンズ群し1は、物体側より順に、両凸形状の非球値正レンズ1枚よりなる。2枚のミラーを含む群し2は、往後光学系である屈折レンズ群Rと第1のミラーM1、第2のミラーM2よりなる。往後光学系である屈折レンズ群Rは物体側に凹面を向けた略平凹形状の非球面負レンズにより構成されている。第1のミラーM1は、物体側に凹面を向けた非球面凹面鏡にて構成されている。第2のミラーM2は、平面ミラーにて構成されている。第2のミラーM2は、平面ミラーにて構成されている。

【0044】また、第1結像光学系にて結像した中間像付近にフィールドレンズ群Fは、物体側より順に、両凸形状の非球面正レンズ、像側に凹面を向けたメニスカス形状の非球面正レンズ、により構成されている。第2結像光学系G2は、物体側から順に、像側に凹面を向けたメニスカス形状の非球面負レンズ、関口絞り、両凸形状の非球面正レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正球面レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状の正球面レンズ、像側に凸面を向けた非球面正レンズ、物体側に凸面を向けた昨平凸形状の非球面正レンズ、よりなる。本実施例においては、第2結像光学系G2に強い負レンズを有する構成となっている。

【0045】[実施例3]実施例3の具体的なレンズ構成を図6に示す。投影倍率は1/4倍であり、基準波長は157nm、硝材としては蛍石を用いている。また、像側の開口数はNA=0.68、物像間距離(第1の物体面〜第2の物体面)はし=約1185mmである。また、像高がおよそ11、25~20、25mmの範囲にて収差補正されており、少なくとも長さ方向で26mm、福で8mm程度の円弧状の露光領域を確保できる。また、本実施例の縦及び横収差図を図10に、数値実施形態の構成諸元値を表3に示す。尚、収差図は基準波長及び±2pmの波長について表示している。

【0046】 屈折レンズ群し1は、物体側より順に、物体側に凹面を向けたメニスカス形状の非球面正レンズ、両凸形状の非球面正レンズよりなる。往後光学系である屈折レンズ群片は物体側に凹面を向けたメニスカス形状の非球面質レンズにより構成されている。第1のミラーM1は、物体側に凹面を向けた井球面凹面鏡にて構成されており。正の屈折力を有するとともに、像面湾曲を正方向に出して、屈折レンズにて構成されている。第2のミ

ラーM 2は、像側に凹面を向けた非球面凹面鏡にて構成されており、第1の物体101上の軽外光速を第1のミラーの有効径外へと導いている。中間像は、第1のミラーM 1の有効径外の近傍に形成されている。また、本実施例においては、中間像付近にフィールドレンズ群ドを配置している。このフィールドレンズ群ドは、物体側より順に、像側に凸面を向けたメニスカス形状の非球面正レンズ、両凸形状の非球面正レンズ、よりなる。

【0047】第2結像光学系G2は、物体側から順に、 物体側に凸面を向けたメニスカス形状の非球面正レンズ、開口絞り、像側に凸面を向けた非球面正レンズ、像側に凸面を向けた非球面正レンズ、像側に凸面を向けた非球面正レンズ、像側に凸面を向けた非球面正レンズ、よりなる。この第2結像光学系G2は、フィールドレンズ群ドからの光東を第2の物体面上102に結像するために縮小系を構成し、開口絞りに対して光東に角度を持って入射させることにより、開口絞り付近の展析レンズの有効径を小さく抑えている。このような配置を取ることにより、軸上色収差や球面収差等の諸収差の発生を低減するともに、第1結像光学系にて発生する諸収差と打ち消しあうことで、全系において良好な収差補正を達成している。

【0048】〔実施例4〕実施例4の具体的なレンズ構成を図7に示す。投影倍率は1/5倍であり、基準波長は157nm(F2エキシマレーザ光の波長)、硝材としては蛍石を用いている。また、像側の開口数はNA=0.60、物像間距離(第1の物体面〜第2の物体面)は上=約1411mmである。また、像高がおよそ9~15mmの範囲にて収差補正されており、少なくとも長き方向で20、8mm、橋で5mm程度の円弧状の露光領域を確保できる。また、本実施例の縦及び横収差図を図11に、数値実施形態の構成諸元値を表4に示す。

【0049】物体側から順に、正の照析力を有する照析 レンズ群し1、第1のミラーである凹面鏡M2、第2の ミラーである凹面鏡M2、及び第2結像光学系G2より 構成されている。尚、本実施例では、2枚のミラーを有 する群し2中に、屈折レンズ群日は存在しないととも に、フィールドレンズ群日も存在しない。屈折レンズ群 し1は、物体側より順に、像側に凸面を向けた略平凸形 状の非球面正レンズ、両凸形状の非球面正レンズよりな る。

【0050】第1のミラーM1は、物体側に関面を向けた非球面関面鏡にて構成されている。第2のミラーM2は、像側に関面を向けた非球面関面鏡にて構成されており、第1の物体101上の軸外光束を第1のミラーの有効径外へと導いている。中間像は、第1のミラーM1の有効径外の近傍に形成されている。本実施例では、第1結像光学系G1は縮小系を形成している。第2結像光学系G2は、物体側から順に、両凸形状の非球面正レン

ズ、開口絞り、像側に凹面を向けた2枚のメニスカス形状の非球面正レンズ、物体側に凸面を向けた非球面正レンズ、よりなる。この第2結像光学系G2は、第2のミラーM2からの光束を第2の物体面上102に結像するために縮小系を構成している。以上の4つの実施例において、実施例2以外は、第1のミラーM1が全て非球面としたが、球面で構成しても構わない。また、実施例中の屈折レンズは、実施例1、実施例2を除いて全て非球面レンズであるが、球面レンズと混在して用いても構わない。また、非球面レンズは、全て非球面の加工面の裏面が球面で構成されているが、平面或いは非球面で構成されていても構わない。また、第1のミラー或いは第2のミラーは屈折力を持たない非球面で構成しても構わない。

【0051】本発明における以上の実施例1〜実施例4 では露光領域は円弧状としたが、収差補正されている器 光領域内であれば矩形でも他の形状でも構わない。ま た、2枚のミラーを含む群し2において、屈折レンズ群 Rを含む構成を示したが、この屈折レンズ群Rとミラー が一体化、即ちマンジンミラーにて構成されていても構 わない。或いは、屈折レンズ群Rと第2のミラーM2と を一体化してマンジンミラーとしてもよい。また、以上 の実施例において、円錐定数kをゼロとした非球面デー 夕があるが、円錐定数を変数にとって設計しても構わな い。また、今回は霧光光源として波長157nmのF2 エキシマレーザーを用いたが、KェFエキシマレーザー (波長248nm) 或いは、ArFエキシマレーザー (波長193nm)等でも構わない。特に、波長が短く なり、用いることができる光学材料が限られるとともに 透過率が低く、光学系の構成枚数を少なくしなければな らないような光学系に用いる場合に有効となる。従っ て、250 nm以下の被長にて用いられる光学系には特 に有効である。また、今回の実施例は、F2エキシマレ ーザ光の波長157 nmにおける硝材としてすべて重石 を用いたが、このような波長1570mにて使用可能 な。例えばフッ素ドーブの石英等、他の硝材を用いるこ とができればその硝材を用いても構わない。また、Kェ FやArF光源の場合、蛍石と石英を混在して用いても 構わないし、どちらか一方を用いても構わない。

【0052】[実施例5] 図12は本発明の実施例5の 光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の波長 157nmを用い、NAO.6、投影倍率β=1/6、 レンズ共役長し=1005mm、像面上の結像領域は像 高にして8、64mmから14、40mmの輪帯状の光 学系をミラー2枚、レンズ9枚という少ない構成枚数に より達成している。本実施例において、r1~r2は第 1結像系Gr1であり、凹頭の第1ミラーM1、凹面の 第2ミラーM2で構成している。r3~r8はフィール F光学系Gr1であり、第1ミラーM1の像側背後に位 置する正レンズFし1を含む2枚の正レンズと1枚の負 レンズで構成している。ドラ〜ド21は第2結像系Gド 2であり、ド11の絞りと4枚の正レンズと2枚の負レ ンズで構成している。

【0053】本実施例においては、第1結像系Gr1の 倍率が最も縮小系となっているため、条件式(2)の上 眼近傍の値となっている。なお、数値実施形態の構成諸 元値を表5に示す。本実施例では像側作動距離30mm を確保しており、光路上の全硝子長は224、7mmと 格段に短くなっている。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の227mmであるが、第2結像系の最 大径は125mmとNAが0、6にもかかわらず小さく なっている。次に、収差図を図29に示すが、収差が良 好に補正されているのがわかる。

【0054】[実施例6]図13は本発明の実施例6の 光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の波長 157nmを用い、NAO、6、投影倍率β=1/5、 レンズ共役長し=956mm、像面上の結像領域は像高 にして7、2mmから14、40mmの輪帯状の光学系 をミラー2枚、レンズ10枚という少ない構成枚数によ り達成している。本実施例において、r1~r4は第1 結像系Gr1であり、(11、r2)はG1群としての 近レンズ、四面の第1ミラーM1、四面の第2ミラーM 2で構成している。r5~r10はフィールド光学系G rfであり、第1ミラーM1の像側背後に位置する正レ ンズFL1を含む2枚の正レンズと1枚の負レンズで構 成している。r11~r23は第2結像系Gr2であ り、r13の絞りと4枚の正レンズと2枚の負レンズで 構成している。

【0055】本実施例においては、第1ミラーM1での倍率がより縮小傾向となっているため条件式(8)の下限近傍の値となっている。またこれにより第1結像系G r1における近軸での中間像は光束が第1ミラーM1で反射後、第2ミラーM2へ入射する手前に形成しているため、条件式(5)の下限近傍の値となっている。なお、数値実施形態の構成結元値を表6に示す。本実施例では像側作動距離31mmを確保しており、光路上の全硝子長は232.1mmと格段に短くなっている。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の196mmであるが、第2結像系の最大径は143mmとNAが0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図30に示すが、収差が良好に補正されているのがわかる

【0056】 [実施例7] 図14は本発明の実施例7の 光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の波長 157 nmを用い、NAO、6、投影倍率β=1/5。 レンズ共役長し=1199mm、像面上の結像領域は像 高にして8、4mmから14、0mmの輪帯状の光学系 をミラー2枚、レンズ9枚という少ない構成枚数により 達成している。本実施例において、r1~r4は第1結 像系Gr1であり、(r1, r2)はG1群としての正 レンズ、側面の第1ミラーM1、側面の第2ミラーM2で構成している。r5~r12はフィールド光学系Gr fであり、第1ミラーM1の像側背後に位置する正レンズFL1を含む3枚の正レンズと1枚の負レンズで構成している。r13~r21は第2結像系Gr2であり、r13の絞りと4枚の正レンズで構成している。

【0057】本実施例においては、第1結像系Gr1における職共役点の位置が第1ミラー州1の位置に対し正の方向へ大きく離れているために条件式(4)の上限近傍の値となっており、また光学全長に対し物体面から第1ミラー州1の距離が短くなっているため、条件式

(7)の下限近傍の値となっている。なお、数値実施形態の構成諸元値を表7に示す。本実施例では像側作動距離35.1mmを確保しており、光路上の全硝子長は333.8mmと格段に短くなっている。また、光学系全系の数大径はフィールド光学系の250mmであるが、第2結像系の最大径は143mmとNAが0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図31に示すが、収差が良好に補正されているのがわかる。

【0058】 [実施例8] 図15は本発明の実施例8の 光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の波長 157nmを用い、NAO、6、投影倍率β=1/5、 レンズ共役長し=1198mm、像面上の結像領域は像 高にして8、4mmから14、0mmの輪帯状の光学系 をミラー2枚、レンズ10枚という少ない構成枚数によ り達成している。本実施例において、 r1~ r10は第 1結像系G r 1であり、(r 1, r 2)はG 1群として の正レンズ、(r3, r4)、(r6, r7)、(r 9、 r 1 0) は物理的に第1ミラーM1と凹面の第2ミ ラーM2の間に配置した同一の負レンズ、それと第1ミ ラーM1と凹面の第2ミラーM2で構成している。r1 1~r18はフィールド光学系Grfであり、第1ミラ ーM1の機働背後に位置する正レンズFL1を含む3枚 の正レンズと1枚の負レンズで構成している。ド19~ r27は第2結像系Gr2であり、r19の絞りと4枚 の正レンズで構成している。

【0059】本実施例においては、第1結像系Gr1で 物理的に第1ミラーM1と凹面の第2ミラーM2の間に 配置した負レンズは、第2ミラーからの反射光束が第1 ミラーM1と干渉する不具合を凹避するためと、歪曲収 差等の補正のために配置している。なお、数値実施形態 の構成諸元値を表8に示す。本実施例では像側作動距離 36.1mmを確保しており、光路上の全硝子長は33 7.6mmと格段に短くなっている。また、光学系全系 の数大径はフィールド光学系の245mmであるが、第 2結像系の数大径は142mmとNAが0.6にもかか わらず小さくなっている。次に、収差図を図32に示す が、収差が良好に補正されているのがわかる。

【0060】[実施例9]図16は本発明の実施例9の 光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の波長

157 nmを用い、NAO、6、投影倍率β=1/5、 レンズ共役長し=1166mm、像面上の結像領域は像 高にして7.7mmから14.0mmの輪帯状の光学系 をミラー2枚、レンズ12枚という少ない構成枚数によ り達成している。本実施例において、ドイード14は第 1結集系Gr1であり、(r1、r2)はG1群として の正レンズ、(r3, r4)、(r10, r11)、 (r 1 3, r 1 4) は岡一の正レンズLP1で第2ミラ ーM2と共に第2ミラー群GM2を構成し、(r5、r 6)、(r8, r9)は同一の負レンズLN1で第18 ラーM1と共に第1ミラー群GM1を構成している。r 15~122はフィールド光学系Grずであり、第13 ラーM1の像側背後に位置する正レンズドし1を含む3 枚の正レンズと1枚の負レンズで構成している。r23 ~ r 3 3 は第 2 結像系 G r 2 であり、 r 2 7 の絞りと 4 **枚の正レンズと1枚の負レンズで構成している。**

【0061】本実施例においては、第1結像系Gr1に よる中間像の位置が第1ミラーM1の位置とほぼ一致し ており第1ミラー群GM1の外側で中間像を形成してい るので、光東と第1ミラー群GMIとの干渉の不具合が 回避しやすく、かつフィールド光学系Grfの径をも大 きくすることを抑制することができるので効率的な構成 となっている。また第2ミラー群GM2を正レンズLP 1と第2ミラーM2で構成し、ペッツバール和をコント ロールしている。一方、中間像の結像状態が程度いので この位置に視野絞りを設けることもできる。なお、数値 実施形態の構成諸元値を表りに示す。本実施例では像側 作動距離30、3mmを確保しており、光路上の全硝子 長は400.5mmと格段に短くなっている。また、光 学系全系の最大径はフィールド光学系の213mmであ るが、第2結像系の最大径は157mmとNAが0.6 にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図3 3に示すが、収差が良好に補正されているのがわかる。 【0062】 [実施例10] 図17は本発明の実施例1 0の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の 波長157 n mを用い、NAO、6、投影倍率β=1/ 5、レンズ共役長L=1160mm。像面上の結像領域 は像高にして7.7mmから14.0mmの輸幣状の光 学系をミラー2枚、レンズ12枚という少ない構成枚数 により達成している。本実施例において、ア1~ア14 は第1結集系Gr1であり、(r1, r2)はG1群と しての誰レンズ、(m3、m4)。(m10、ml 1)、(r13, r14)は同一の正レンズLP1で第 2ミラーM2と共に第2ミラー群GM2を構成し、(r 5, r6)、(r8, r9)は脚一の負レンズLN1で 第1ミラーM1と共に第1ミラー群GM1を構成してい る。ド1ラード22はフィールド光学系のドイであり、 第1ミラーM1の像側背後に位置する正レンズFL1を 含む3枚の正レンズと1枚の負レンズで構成している。 r23~r33は第2結像系Gr2であり、r27の絞

りと4枚の正レンズと1枚の貧レンズで構成している。 【0063】本実施例では、特に第1結係系のよりにお ける第1ミラー群GM1を負レンズLN1と第1ミラー 341で構成し各々のパワーを強めることにより、光学系 全系に対する色収差補正効果を大きくしている。また第 2ミラー群GM2を正レンズLP1と第2ミラーM2で 構成し、ペッツバール和をコントロールしている。な お、数値実施形態の構成諸元値を表10に示す。本実施 例では像側作動距離30.0mmを確保しており、光路 上の全硝子長は375、9mmと格段に短くなってい る。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の2 66mmであるが、第2結像系の最大径は105mmと NAが0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、 収差図を図34に示すが、主波長が157nmで2pm の波長範囲について示しており収差が良好に補正されて いるのがわかる。

【0064】 [実施例11] 図18は本発明の実施例1 1の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の 波長157 nmを用い、NAO. 6、投影倍率β=1/ 4、レンズ共役長し…1430mm、保護上の結集領域 は健高にして8,19mmから13,65mmの輪帯状 の光学系をミラー2枚、レンズ12枚という少ない構成 枚数により達成している。本実施例において、ア1~ア 12は第1結像系Gr1であり、(r1, r2)はG1 群としての正レンズ。(r3, r4)、(r6, r7) は岡一の負レンズLN1で第1ミラーM1と共に第1ミ ラー群GM1を構成し、(r8、r9)、(r11、r 12)は岡一の正レンズLP1で第2ミラーM2と共に 第2ミラー群GM2を構成している。 r13~r20は フィールド光学系Grfであり、第1ミラーM1の像棚 背後に位置する正レンズFL1を含む3枚の正レンズと 1枚の負レンズで構成している。 r21~r31は第2 結像系Gr2であり、r25の絞りと4枚の正レンズと 1枚の負レンズで構成している。

【0065】本実施例でも、実施例10と同様に第1ミラー群GM1の構成の故に色収差補正効果を大きくしている。また第2ミラー群GM2を正レンズしP1と第2ミラーM2で構成し、ペッツバール和をコントロールしている。なお、数値実施形態の構成諸元値を表11に示す。本実施例では像側作動距離30.0mmを確保しており、光路上の全硝子長は371.9mmと格段に短くなっている。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の328mmであるが、第2結像系の最大径は141mmとNAが0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図35に示すが、主波長が157nmで4pmの波長範囲について示しており収差が良好に補正されているのがわかる。

【0066】 [実施例12] 図19は本発明の実施例1 2の光路図であり、基準波長はF2光源で157nm。 NAO. 6、投影倍率β=1/4、レンズ共役長し=1

430mm、像面上の結像鍵域は像高にして8.19m mから13、65mmの輪帯状の光学系を実施例11と 同様なミラー2枚、レンズ12枚という少ない構成枚数 により達成している。本実施例において、ア1~ア12 は第1結集系Gr1であり、(r1, r2)はG1群と しての正レンズ、(r3, r4)、(r6, r7)は同 一の負レンズLN1で第1ミラーM1と共に第1ミラー 群GM1を構成し、(r8, r9)、(r11, r1 2)は同一の正レンズLP1で第2ミラーM2と共に第 2ミラー群GM2を構成している。図20においては、 正レンズ群G1も正レンズLP1も半円盤状となってい る。 r 13~r 20はフィールド光学系Grfであり、 第1ミラー群GM1の外側に位置し中心部分がくり抜か れたドーナツ形状の正レンズドし1を含む3枚の正レン ズと1枚の負レンズで構成している。 r 21~ r 31は 第2結像系Gr2であり、r25の絞りと4枚の正レン ズと1枚の負レンズで構成している。

【0067】本実施例では、第1結像系Gr1の瞳共後 点がより物体側にあるので条件式(4)では下限近傍の 値を有している。そして実施例10と同様に第1ミラー 群GM1の構成の故に色収差補正効果を大きくしてい る。またフィールド光学系Grfの正レンズFL1をド ーナツ形状とし、その中心部分に第1結像系Gr1の第 1ミラー群GM1を配置することにより、より物体側で 光線を屈折させることができるので、フィールド光学系 Grfや第2結像系Gr2のパワーを小さくすることが でき、収差補正上の利点となる。また第2ミラー群GM 2を正レンズLP1と第2ミラーM2で構成し、ペッツ バール和をコントロールしている。なお、数値実施形態 の構成諸元値を表12に示す。本実施例では像側作動能 離30.0mmを確保しており、光路上の全硝子長は3 77.0mmと格段に短くなっている。また、光学系全 系の最大径はフィールド光学系の328mmであるが、 第2結像系の最大径は144mmとNAが0.6にもか かわらず小さくなっている。次に、収差図を図36に示 すが、主波長が157nmで4pmの波長範囲について 示しており収差が良好に補正されているのがわかる。

【0068】 [実施例13] 図20は本発明の実施例13の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の波長157nmを用い、NAO.6、投影倍率8-1/5、レンズ共役長し-1100mm、保面上の結像領域は像高にして10、24mmから13、65mmの輪帯状の光学系をミラー4枚、レンズ5枚という非常に単純化された構成により達成している。本実施例において、r1~r2は第1結像系Gr1であり、凹面の第1ミラーM1、凹面の第2ミラーM2のみで構成している。r3~r4はフィールド光学系Grfであり、凹面第1フィールドミラードM2のみで構成している。r3~r4はフィールド光学系Grfであり、凹面第1フィールドミラードM1と凸面の第2フィールドミラードM2のみで構成している。r5~r15は第2結像系Gr2であり、r5の絞りと4枚の正レンズと1枚の負し

ンズで構成している。本実施例においては、光学系全系の共役長に対し相対的に第1ミラーM1がより物体側に位置しており条件式(12)の下限近傍の値となっている。なお、数値実施形態の構成諸元値を表22に示す。本実施例では像側作動距離30mmを確保しており、光路上の全硝子長は192、2mmと非常に短くなっている。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の388mmであるが、第2結像系の最大径は167mmとNAが0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図37に示すが、収差が良好に補正されているのがわかる。

【0069】 [実施例14] 図21は本発明の実施例1 4の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の |被長157 n mを用い、NAO、6、投影倍率β=1/ 5. レンズ共役長し…1100mm、傑頭上の結集領域 は僅高にして10、24mmから13、65mmの輪帯 状の光学系をミラー4枚、レンズ6枚と実施例22にレ ンズ1枚が付加した単純化された構成により達成してい る。本実施例において、ド1~ド2は第1結像系Gド1 であり、凹面の第1ミラーM1、ほぼ平面に近いが凹面 の第2ミラーM2のみで構成している。ド3~ド8はフ ィールド光学系Grfであり、凹面の第1フィールドミ ラーFM1と凸面の第2フィールドミラーFM2、(c 4、r5)、(r7, r8)の間一の負レンズLFで精 成している。ドラード19は第2結像系Gド2であり、 r 9の絞りと4枚の正レンズと1枚の負レンズで構成し ている。本実施例においては、凸面の第2フィールドミ ラードM2と負レンズLFで構成された第2フィールド ミラー群GFM2によりペッツバール和もコントロール している。また第2結像系Gr2における倍率が小さく なっており、条件式(1)の上限近傍の値となってお り、第1結像系Gr1に正レンズ群G1を構成していな いので第2ミラーM2がより物体側に位置しており条件 式(6)の上限近傍の値となっている。なお、数値実施 形態の構成諸元値を表14に示す。本実施例では像側作 動距離30mmを確保しており、光路上の全硝子長は1 56.4mmと非常に短くなっている。また、光学系全 系の最大径はフィールド光学系の444mmであるが、 第2結構系の最大径は144mmとNAが0.6にもか かわらず小さくなっている。次に、収差図を図38に示 すが、収差が良好に補正されているのがわかる。

【0070】 [実施例15] 図22は本発明の実施例15の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の波長157nmを用い、NAO、6、投影倍率β=1/4、レンズ共役長し=1190mm、像面上の結像領域は像高にして9、56mmから13、65mmの輪帯状の光学系をミラー4枚、レンズ8枚と実施例23にレンズ2枚が付加した構成により達成している。本実施例において、r1~r8は第1結像系Gr1であり、(r1,r2)はG1群としての正レンズ、(r3,r

4)、(r6, r7)は岡一の負レンズLN1、凹面の 第1ミラーM1、凸面の第2ミラーM2で構成してい る。r9~r14はフィールド光学系Grfであり、凹 面の第1フィールドミラードN1と凸面の第2フィール F\$5-FM2 (r10, r11) (r13, r1 4)の同一の正レンズLFで構成している。r15~r 25は第2結像系Gr2であり、r15の絞りと4枚の 正レンズと1枚の負レンズで構成している。本実施例に おいては、第1結像系Gr1において凸レンズ群G1を 構成することにより物体側テレセントリックを形成し、 第1ミラー群GM1を負レンズLN1と第1ミラーM1 で構成することにより、色補正を行っている。凸面の第 2フィールドミラードM2と正レンズしFで構成された 第2フィールドミラー群GFM2によりペッツバール和 もコントロールしている。また第1結像系Gr1の験共 役点がより物体側にあるので条件式(10)の下限近傍 の値となっている。第2フィールドミラーFM2と第1 フィールドミラードM1との開闢も相対的に大きくなっ ているため条件式(14)の上限近傍の値となってい る。なお、数値実施形態の構成諸元値を表15に示す。 本実施例では像側作動距離36mmを確保しており、光 路上の全硝子長は203.7mmと非常に短くなってい る。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の5 1 2 m m であるが、第 2 結像系の最大径は 1 4 6 m m と NAがり、6にもかかわらず小さくなっている。次に、 収差図を図39に示すが、主波長が1570mで4pm の減長範囲について示しており収差が良好に補正されて いるのがわかる。

【0071】[実施例16]図23は本発明の実施例1 6の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の 波長157nmを用い、NAO, 6、投影倍率0=1/ 5、レンズ共役長L=1190mm、像面上の結像領域 は像高にして9.56mmから13.65mmの輪帯状 の光学系をミラー4枚、レンズ9枚と実施例24にレン ズ1枚が付加した構成により達成している。本実施例に おいて、r1~r8は第1結像系Gr1であり、(r 1、r2)はG1群としての正レンズ、(r3, r 4)。(r6, r7)は同一の負レンズLN1、凹面の 第1ミラーM1、凸面の第2ミラーM2で構成してい る。r9~r16はフィールド光学系Grfであり、正 レンズドし1、凹面の第1フィールドミラードM1、凸 面の第2フィールドミラードM2。(r12,r1 3)、(r15, r16)の岡一の負レンズLFで構成 している。ド17~ド27は第2結像系のド2であり。 エ17の絞りと4枚の正レンズと1枚の負レンズで構成 している。本実施例においては、第1結像系GF1の倍 率を一3、838倍とやや拡大系としているため、フィ ールド光学系Gr fに含まれる正レンズFし1を第1ミ ラーM 1の像側背後に配置し、径の増大を抑制してい る。また負レンズしN1と第1ミラーM1で構成された 第1ミラー群GM1と、凸面の第2フィールドミラード M2と負レンズLFで構成された第2フィールドミラー 群GFM2によりベッツバール和をコントロールしている。なお、数値実施形態の構成諸元値を表16に示す。 本実施例では像側作動距離36mmを確保しており、光路上の全硝子長は292、8mmと非常に短くなっている。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の294mmであるが、第2結像系の最大径は184mmと NAが0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図40に示すが、収差が良好に補正されているのがわかる。

【0072】 [実施例17] 図24は本発明の実施例1 7の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の |被長157 n mを用い、NAO、6、投影倍率β=1/ 4. レンズ共役長し = 1188 mm、 傑頭上の結集領域 は傑高にして9.56mmから13.65mmの輪帯状 の光学系をミラー4枚。レンズ9枚という構成により達 成している。本実施例において、 r1~r8は第1結像 系Gr1であり。(r1. r2)はG1群としての正レ ンズ、(r 3, r 4)、(r 6, r 7) は岡一の負レン ズレN1、凹頭の第1ミラーM1、凸面の第2ミラーM 2で構成している。r9~r16はフィールド光学系G r f であり、正レンズF l. 1、四面の第2フィールドミ ラードM1、凹面の第2フィールドミラードM2、(r 12、 r 1 3) 。 (r 1 5、 r 1 6) の鬪一の正レンズ LFで構成している。r17~r27は第2結像系Gr 2であり、r17の絞りと4枚の正レンズと1枚の負レ ンズで構成している。本実施例においては、フィールド 光学系Grfにおいて凹面の第2フィールドミラーFM 2とその像面側背後に正レンズLFを配置したことによ り、この正レンズLFの像画側直後においても中間像を 形成しており、光学系全体として3回結像となってい る。したがってフィールド光学系Grf以降においては 正のパワーが大きくなっておリスペース的に小さくなっ ているので、第1ミラーM1の位置は相対的に像演測に 位置しており、条件式(12)の上限近傍の値となって いる。また第1ミラーM1での倍率がより縮小傾向とな っているため条件式(13)の下限近傍の値となってお り、これにより第1結像系Gr1における近軸での中間 像は光東が第2ミラーM2で反射後。より物体側で形成 しているため、条件式(11)の下限近傍の値となって いる。第1ミラー群GM1を負レンズLN1と第1ミラ ─M1で構成することにより色補正も行っている。な お、数確実施形態の構成譜元値を表17に示す。本実施 例では像側作動距離36mmを確保しており、光路上の 全硝子長は303、3mmと非常に短くなっている。ま た、光学系全系の最大径はフィールド光学系の323m mであるが、第2結像系の最大径は125mmとNAが 6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図 を図41に示すが、主波長が157nmで2pmの波長 範囲について示しており収差が良好に補正されているのがわかる。

【0073】 [実施例18] 図25は本発明の実施例1 8の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の 波長157 nmを用い、NAO、6、投影倍率β=1/ 4、レンズ共役長し=1197mm、像面上の結像領域 は像高にして10.0mmから20.0mmと大きく確 保した輪帯状の光学系をミラー4枚、レンズ9枚と実施 例16と同様な構成により達成している。本実施例にお いて、r1~r8は第1結像系Gr1であり、(r1, r(2)はG1群としての正レンズ、(r(3), r(4))。 (r6, r7)は同一の負レンズLN1、凹面の第13 ラーM1、凸面の第2ミラーM2で構成している。 r 9 ~ r 1 6はフィールド光学系G r f であり、正レンズF 1.1、凹面の第1フィールドミラーFM1、凸面の第2 フィールドミラーFM2、(r12, r13)、(r1 5, r16)の同一の正レンズしFで構成している。r 17~r27は第2結像系Gr2であり。r17の絞り と4枚の正レンズと1枚の負レンズで構成している。本 実施例においては、第1ミラー群GM1を負レンズLN 1と第1ミラーM1で構成することにより、色補正を行 っている。また凸面の第2フィールドミラーFM2と正 レンズLFで構成された第2フィールドミラー群GFM 2によりペッツバール和もコントロールしている。な お、数値実施形態の構成器元値を表18に示す。本実施 例では像側作動距離37mmを確保しており、光路上の 全硝子長は286.8mmと非常に短くなっている。ま た。光学系全系の最大径はフィールド光学系の442m mであるが、第2結像系の最大径は165mmとNAが O. 6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図 を図42に示すが、主波長が157nmで4pmの波長 範囲について示しており収差が良好に補正されているの がわかる。

【0074】 [実施例19] 図26は本発明の実施例1 9の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の 波長157 nmを用い、NAO、6、投影倍率β=1/ 5、レンズ共役長し=934mm、像面上の結像領域は 像高にして7.7mmから14.0mmの輪帯状の光学 系をミラー4枚、レンズ10枚という構成により達成し ている。本実施例において、ド1~ド10は第1結像系 Gr1であり、(r1, r2)、(r3, r4)は正レ ンズでG1群を構成し、(c5、r6)、(8c,r 9)は岡一の負レンズLN1、四面の第1ミラーM1。 四節の第2ミラーM2で構成している。 r11~r18 はフィールド光学系Grfであり。正レンズドし1、凹 面の第1フィールドミラードM1、凸面の第2フィール FS9-FM2、(r14, r15)。(r17, r1 8)の同一の正レンズしFで構成している。r19~r 29は第2結像系Gr2であり、r19の絞りと4枚の 正レンズと1枚の負レンズで構成している。本実施例に おいては、第1ミラー群GM1を貸レンスLN1と第1 ミラーM1で構成することにより、色補正を行ってい る。凸面の第2フィールドミラーFM2と正レンズLF で構成された第2フィールドミラー群GFM2によりべ ッツバール和もコントロールしている。また第1結像系 Gr1の倍率が最も縮小器となっているため、条件式。 (9)の上限近傍の値となっている。第2フィールドミ ラードM2と第1フィールドミラードM1との間隔は相 対的に小さくなっているため条件式(14)の下限近傍 の値となっている。なお、数値実施形態の構成諸元値を 表19に示す。本実施例では像側作動距離33.7mm を確保しており、光路上の全硝子長は264.4mmと 非常に短くなっている。また、光学系全系の最大径はフ ィールド光学系の293mmと比較的小さくなってお り、第2結像系の最大径も130mmとNAが0.6に もかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図43 に示すが、主波長が157 amで2pmの波長範囲につ いて示しており収差が良好に補正されているのがわか

【0075】 [実施例20] 図27は本発明の実施例2 0の光路図であり、基準波長はF2エキシマレーザ光の 波長157 nmを用い、NAO. 6、投影倍率β=1/ 8、レンズ共役長し=1190mm、像面上の結像領域 は像高にして9、56 mmから13、65 mmの輪帯状 の光学系をミラー4枚、レシズ9枚と実施例16と同様 な精成により達成している。 本実維例において、 r1~ r 8は第1結像系Gr 1であり、(r1, r2)はG1 群としての正レンズ。(r3, r4)、(r6, r7) は同一の負レンズLN1、凹面の第1ミラーM1。凹面 の第2ミラーM2で構成している。ドリード16はフィ ールド光学系Gr f であり、正レンズF L 1、凹面の第 1フィールドミラードM1、凸面の第2フィ側ルドミラ -FM2、(r12, r13)、(r15, r16)の 岡一の負レンズLFで構成している。 r 17~ r 27は 第2結像系Gr2であり、r17の絞りと4枚の正レン ズと1枚の負レンズで構成している。本実施例において は、まず第1結像系Grlの倍率が大きく拡大傾向とな っているため、条件式(9)の下限近傍の値を有してい る。これは主に第1ミラー群GM1での倍率が正であり 条件式(13)の上限近傍の値を有していることによ る。これにより条件式(11)の上限近傍の値を有して いるように、第1結像系Cr1による中間像の位置は大 きく第1ミラーM1から離れている。また第1結像系G r 1の臓共役点が第1ミラーM1に対しより像面側にあ るので条件式(10)の上限近傍の値となっている。そ して負レンズしN1と第1ミラーM1で構成された第1 ミラー群GM1と、凸面の第2フィールドミラーFM2 と負レンズLFで構成された第2フィールドミラー群G FM2によりペッツバール和もコントロールしている。 なお、数値実施形態の構成諸元値を表20に示す。本実

施例では像側作動距離36mmを確保しており、光路上の全硝子長は315.5mmと非常に短くなっている。また、光学系全系の最大径はフィールド光学系の355mmであるが、第2結係系の最大径は177mmとNAが0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図を図44に示すが、収差が良好に補正されているのがわかる。

【0076】 〔実施例21〕 図28は本発明の実施例2 1の光路図であり。基準波長はF2エキシマレーザ光の 波長157nmを用い、NAO. 6、投影倍率β==1/ 10、レンズ共役長し=1190mm、像面上の結像領 域は堡高にして9、56mmから13、65mmの輪帯 状の光学系をミラー4枚、レンズ9枚と実施例25と同 様な構成により達成している。本実施例において、ド1 ~ r 8 は第 1 結像系G r 1 であり、(r 1, r 2) は G 1群としての正レンズ、(r3, r4)、(r6, r 7)は同一の負レンズLN1、凹面の第1ミラーM1、 ほぼ平面だが凸面状の第2ミラーM2で構成している。 r9~r16はフィールド光学系Grfであり、正レン ズFL1、側面の第1フィールドミラーFM1、凸面の 第2フィールドミラーFM2、(r12, r13)、 (r15, r16)の同一の負レンズLFで構成してい る。r 1 7~r 2 7は第2結業系G r 2であり、r 1 7 の絞りと4枚の正レンズと1枚の負レンズで構成してい る。本実施例においては、第2結像系G r 2の倍率が条 件式(1)の下限近傍の値を有しており、また、第2ミ ラーM2と第1ミラーM1の距離が短く、条件式(6) の下限近傍の値を有していることが特徴的である。そし て貫レンズLN1と第1ミラーM1で構成された第1ミ ラー群GM1と、凸面の第2フィールドミラーFM2と 負レンズLFで構成された第2フィールドミラー群GF M2によりペッツバール和もコントロールしている。な お、数値実施形態の構成諸元値を表21に示す。本実施 例では像側作動距離36mmを確保しており、光路上の 全硝子長は301.7mmと非常に短くなっている。ま た、光学系全系の最大径はフィールド光学系の310m

mであるが、第2結像系の最大径は180mmとNAが 0.6にもかかわらず小さくなっている。次に、収差図 を図45に示すが、収差が良好に補正されているのがわ かる。

【0077】なお、以上の実施例5~実施例21におい ては非球面を使用しており円錐定数kをゼロとしている レンズ面があるが、円錐定数kを変数にとって設計して も構わない。さらに、本実施例ではすべてF2光源の場 合でありその硝材を蛍石(n == 1 . 5 6 0 0)で構成し ているが、一部にファ素ドープの石英を用いてもよい。 また光源はArFエキシマレーザでも、KrFエキシマ レーザでもよく、この場合は、蛍石と石英の両方とも用 いることが可能なので色収差をより小さく補正すること ができる。またどちらか1硝種のみで光学系を構成した 場合でも、F2の場合よりも分散が小さくなるので、色 収差の補正が容易となる。上記実施例1~実施例21の 投影光学系は、ステップ&スキャン方式でレチクル(マ スク)のデバイス(cf:回路)パターンを基板(ウェ ハ) 上に投影する走査型投影器光装置の投影光学系とし て用いる。この露光装置でウェハをデバイスパターンで 露光し、露光したウェハを現像しエッチングなどの処理 を施して、デバイス (c f : 半導体チップ) が作られ

【0078】以下に、上記実施例1~実施例21の数値 実施形態の構成諸元を、それぞれの実施例と対応させて 表

【1】~表

【21】を示す。なお、数値実施形態において、riは物体側より順に第1番目のレンズ面の曲率半径、diは物体側より順に第1番目のレンズ厚及び空気間隔、niは物体側より順に第1番目のレンズの硝子の基準液長入=157mに対する屈折率を示すものとする。また、基準波長に対する+2pm及び-2pmの波長の屈折率は、各々1、5599949、1、5600051である。また、非球面の形状は次式、

$$X = \frac{H^{2} / \left(1 - (1 + k) \cdot \left(\frac{H}{N}\right)^{2}\right)^{\frac{1}{2}}}{1 + \left(1 - (1 + k) \cdot \left(\frac{H}{N}\right)^{2}\right)^{\frac{1}{2}}} + A \cdot H^{4} + B \cdot H^{4} + C \cdot H^{8} + D \cdot H^{10} + E \cdot H^{12} + F \cdot H^{14} + G \cdot H^{16} + \dots$$

にて与えられるものとする。ここに、Xはレンズ頂点から光軸方向への変位量、Hは光軸からの距離、riは曲率半径、kは円錐定数、A.、..、Gは非球面係数で

悉表。

[0079]

【表1】〈実施例1〉